

プラズマ研究会

〔委員長〕 石井彰三（東工大）
 〔副委員長〕 小野 茂（武蔵工大）
 〔幹 事〕 小野 靖（東 大）, 安岡康一（東工大）

日 時 10月25日（金） 9：35～17：15
 10月26日（土） 10：00～15：30

場 所 同志社大学今出川キャンパス（京都市内のキャンパス）内，寧静館（ねいせいかん）会議室（京都市上京区今出川通烏丸今出川，JR 京都駅あるいは阪急電鉄京都線烏丸駅から地下鉄烏丸（からすま）線今出川下車すぐ）キャンパス内の地図は下記をご参照下さい。
<http://www.doshisha.ac.jp>

協 賛 電気学会 プラズマイオン高度利用プロセス調査専門委員会（委員長 行村 建）

議 題 テーマ「プラズマイオンプロセスおよび一般」

10月25日（金）9：30～11：35

PST-02-99 チタン陰極アークプラズマイオン注入法による TiN 膜の円板半径方向のコーティング特性

村穂智之，馬 欣新，行村 建（同志社大）

PST-02-100 Ion sheath evolution and its measurement inside a pipe during plasma-based ion implantation and deposition

Xinxin Ma（ハルピン工業大，同志社大），Ken Yukimura（同志社大）

PST-02-101 イオンプラズマ複合プロセスによる低融点亜鉛合金への DLC コーティング

塚本健一，平川大輔，岡 好浩（姫工大），西村芳実（栗田製作所）
 東 欣吾，藤原関夫，八束充保（姫路工大）

PST-02-102 銅イオン注入用プラズマ源におけるイオン生成過程

鈴木 肇，中村圭二，池澤俊治郎（中部大），S.Z.Yang（中国科学院）

PST-02-103 プラズマイオン注入における二次電子放出率の測定とターゲット形状の影響

安藤正樹（名 大），中村圭二（中部大），菅井秀郎（名 大）

10月25日（金）13：00～14：30

PST-02-104 イオン工学の現況

高木俊宜（広島工大）

PST-02-105 “Subplantation”モデルに基づいた動的モンテカルロシミュレーションによるメタンプラズマ中のアモルファス炭素膜形成の解析

宮川佳子，池山雅美，中尾節男，宮川草児（産総研中部センター）

PST-02-106 シャンティングアークによる DLC 薄膜生成

熊谷基也，行村 建（同志社大）

PST-02-107 T-FAD を用いたゴム表面へのダイヤモンドライクカーボン薄膜合成

宮川伸秀，滝川宏史（豊橋技科大）

松下卓史，竹村恵子（フコク），榊原建樹（豊橋技科大）

10月25日（金）14：45～17：15

PST-02-108 プラズマイオン注入による厚膜DLCの残留応力緩和

峠 正範，岡 好浩（姫路工大），西村芳実（栗田製作所）

東 欣吾，藤原関夫，八束充保（姫路工大）

PST-02-109 炭素系ガスプラズマによる DLC コーティング

空野由明，東條弘美，茶谷原昭義，堀野裕治（産総研関西センター）

PST-02-110 陽極蒸発アーク放電法による単層カーボンナノチューブの合成

今泉豊博，藤村洋平，滝川宏史，榊原建樹（豊橋技科大），伊藤茂生（双葉電子）

PST-02-111 大気中トーチアーク法をベースにした多層カーボンナノチューブの連続合成

加藤雅也（豊橋技科大），田原智徳（東海カーボン）

夏目伸一（エイアールブイ），滝川宏史（豊橋技科大）

伊藤茂生（双葉電子），榊原建樹（豊橋技科大）

PST-02-112 プラズマイオン注入における基材の 3 次元形状効果 - 2 次電子の捕捉とイオン電流分布

塩谷健一，池畑 隆，佐藤直幸，田辺利夫，真瀬 寛（茨城大）

行村 建（同志社大）

PST-02-113 無声放電プラズマの印加電圧波形と電力投入式

田中正明，民田太一郎（三菱電機）

10月26日（土）10：00～11：40

PST-02-114 誘電体バリヤ放電を用いた NO 除去の NO ガス温度依存性

長尾一聖，山本 極，行村 建（同志社大）

神原信志（出光興産），丸山敏朗（京都大）

PST-02-115 正弦波パルスを用いたアンモニアラジカルインジェクション方式による NO_x 除去効

率の最適デューティ比

山本 極，長尾一聖，行村 建（同志社大）

神原信志（出光興産），丸山敏朗（京都大）

PST-02-116 フッ素系ガスプラズマ RIE を用いた LiNbO₃，LiTaO₃ 結晶の加工表面評価

藤井隆裕，吉門進三（同志社大）

PST-02-117 プラズマを応用した有害残留物の無い酸化エチレンガス高速滅菌

松本和憲，蟹谷正史（富山県立大），河野 稔，小原隆宏（医器研）

10月26日（土）13：00～15：30

- PST-02-118 大気圧マイクロホローカソード放電の分光観測
安岡康一，渡辺英聡，山竹 厚，白井直機，石井彰三（東工大）
- PST-02-119 RFP プラズマに対する共鳴回転磁場の効果
山本岳人，政宗貞男，太田勝巳，飯田素身（京都工芸繊維大）
- PST-02-120 プラズマイオン注入等価回路を基礎とした RF パースト ICP におけるプラズマ密度の算定
渡邊悟志，水野議一郎，田中 武，高木俊宜（広島工大），
吉田光宏（三菱重工），堀部博志（栗田製作所），行村 建（同志社大）
- PST-02-121 RF パースト ICP における SPICE による回路解析
水野議一郎，渡邊悟志，田中 武，高木俊宜（広島工大），
吉田光宏（三菱重工），堀部博志（栗田製作所），行村 建（同志社大）
- PST-02-122 プラズマイオン注入-堆積プロセス用モジュレータの面積効果
行村 建，村穂智之（同志社大）馬 欣新（ハルビン工業大，同志社大）
- PST-02-123 Ideas to improve discharge characteristics and analysis of the effect in a large-area surface wave plasma for CVDs of diamond films
Jaeho Kim，Makoto Katsurai（東 大）

*1 件あたり，発表 20 分，討論 5 分

* 10 月 25 日（金）研究会終了後，懇親会を行う予定です。奮ってご参加下さい。